

盛美半导体设备（上海）股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二次会议相关事项的事前认可书

根据《中华人民共和国公司法》《盛美半导体设备（上海）股份有限公司章程》《盛美半导体设备（上海）股份有限公司独立董事工作制度》等规定，我们作为盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下称“公司”）独立董事，就公司第二届董事会第二次会议审议的《关于收购股权暨与关联人共同投资的议案》，在查阅公司提供的相关资料并了解相关情况后，作出如下事前认可：

公司本次收购股权暨与关联人共同投资事项为公司开展正常经营管理所需，存在交易的必要性。不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司的经营业绩产生不利影响。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规以及公司《关联交易管理办法》的规定。据此，我们同意将该议案提交公司第二届董事会第二次会议审议，关联董事应当回避表决。

（以下无正文，为签字页）

（本页无正文，为《盛美半导体设备（上海）股份有限公司独立董事对第二届董事会第二次会议相关事项的事前认可书》之签字页）

A handwritten signature in black ink, appearing to read '彭明秀' (Peng Mingxiu), written in a cursive style.

彭明秀

2023年2月3日

（本页无正文，为《盛美半导体设备（上海）股份有限公司独立董事对第二届董事会第二次会议相关事项的事前认可书》之签字页）

A handwritten signature in black ink, appearing to be '张苏彤' (Zhang Suxin), written over a horizontal line.

张苏彤

2023年2月3日

（本页无正文，为《盛美半导体设备（上海）股份有限公司独立董事对第二届董事会第二次会议相关事项的事前认可书》之签字页）



ZHANBING REN

2023年2月3日

（本页无正文，为《盛美半导体设备（上海）股份有限公司独立董事对第二届董事会第二次会议相关事项的事前认可书》之签字页）



张荻

2023年2月3日